

#### APPLICATION DES ACTIONNEURS PIEZOELECTRIQUES AUX SYSTEMES D'ACCORD A FROID RAPIDES DES CAVITES SUPRACONDUCTRICES







17/10/2006 M.FOUAIDY



- Bref historique sur les matériaux piézoélectriques
- Notions fondamentales de piézoélectricité
- Avantages des actionneurs piézoélectriques
- Procédés de fabrication
- Définitions fondamentales et propriétés fonctionnelles
- Exemples d'application
- Pourquoi doit-on réguler la fréquence des cavités supraconductrices ?
- Caractérisation des actionneurs piézoélectriques à basse température
- Les systèmes d'accord à froid rapides
- Résultats récents sur cavités
- Conclusion et perspectives

17/10/2006

## **Bref historique**



En Grec piezô comprimer
 Effet piézoélectrique <u>direct</u> observé dans certains cristaux naturels ou synthétiques (<u>céramiques</u>)

Phénomène découvert par Pierre et Jacques Curie qui ont testé un cristal de tourmaline

→ Application d'une contrainte mécanique suivant certains axes cristallographiques → apparition d'une tension électrique entre les deux faces sollicitées.

• Théorie de Lippmann et vérification expérimentale par Pierre Curie

• Effet piézoélectrique <u>inverse</u>:

Tension électrique dilatation ou contraction dans la direction du champ électrique appliqué

• Loi de Curie "Un cristal qui possède un centre de symétrie ne peut être piézoélectrique "

• 1922: Langevin fabrique le premier capteur piézoélectrique



17/10/2006

## Notions fondamentales de piézoélectricité 1



#### **Piézoélectriques** = céramiques <u>ferroélectriques</u> polarisées



Avant polarisation CFC, isotrope Après polarisation

tétragonale et anisotrope

de Weiss

E

Champ électrique intense E polarisation rémanente dans la direction du champ

Dipôles: orientation <u>aléatoire</u>

Céramique non polarisée

17/10/2006

Durant la polarisation

Après polarisation



**M.FOUAIDY** 

## Notions fondamentales de piézoélectricité 2





A grande distance (R>>r<sub>i</sub>), l'expression précédente peut se simplifier :

$$(4\pi\varepsilon_0).\delta V \cong \frac{\sum_i q_i}{R} + \frac{\left(\sum_i q_i \vec{r}_i\right) \bullet \vec{R}}{R^3}$$

Chaque région étant électriquement neutre, la contribution principale est dipolaire. La polarisation P est le moment dipolaire par unité de volume:

$$\vec{P} = \sum_{i} q_{i} \vec{r}_{i}$$



**M.FOUAIDY** 

17/10/2006

## Notions fondamentales de piézoélectricité 3



Matériau pyroélectrique matériau ayant une polarisation spontanée qui varie avec la température

**Coefficient pyroélectrique** 

$$p = \frac{\partial P}{\partial T}$$

Matériau ferroélectrique est un matériau pyroélectrique dont la polarisation spontanée peut être réorientée par application d'un champ électrique.

**Coefficient pyroélectrique de matériaux piézoélectriques** 

Matériau	p (10 <sup>-6</sup> C/(m <sup>2</sup> .K))
Tourmaline	4
Céramique PZT	380





A) Au repos le cristal a une symétrie d'ordre 3, la somme des trois moments dipolaires est nulle

B) Sous contrainte, cette somme n'est plus nulle : polarisation du cristal

**Relations fondamentales** 

17/10/2006

$$P = \tau . d + E . \varepsilon_0 . \chi$$

**M.FOUAIDY** 

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\tau}{E_Y} + E .d$$

d: Coefficient piézoélectrique, L: Longueur, E<sub>Y</sub>: module de Young E: champ électrique, χ: susceptibilité

**Avantages des actionneurs piézoélectriques 1** 

- IPN rsay

- Résolution infinie
- →Actionneurs piézoélectriques: conversion directe énergie électrique en énergie mécanique.
- → Déplacements sub-nanométriques
- → Ni pièces en mouvement, ni mécanismes, ni liaisons → très haute résolution
- Rapidité
- → Actionneurs piézoélectriques réagissent à l'échelle de la microseconde.
- Supportent de fortes accélération :>10000 g
- Génération de forces élevées
- → Actionneurs piézoélectriques pour fortes charges > plusieurs tonnes!
- → Amplitudes >100 µm avec résolution sub-nanométrique
- Pas de champ magnétique
- → L'effet piézoélectrique n'est sensible qu'au champ électrique!



**Avantages des actionneurs piézoélectriques 2** 

- Faible consommation
- Actionneurs piézoélectriques = Capacité
- → Très faible consommation en fonctionnement statique même pour maintenir ou supporter de fortes charges
- → En statique: pas de pertes
- Ni friction, ni usure Faible maintenance
- → Tests d'endurance: pas de dégradation de performance après plusieurs milliards de cycles!
- Compatibilité ultravide, salle blanche
- Fonctionnement aux températures cryogéniques (T<100K)
- Tenue aux rayonnements (neutrons rapides, X et rayons gamma)



17/10/2006



→La majeur partie des éléments piézoélectriques industriels sont à base de <u>Plombate Zirconate Titanate (PZT)</u>

> Actionneurs piézoélectriques multicouches (multilayer piezostacks)

- 1- Mélange et broyage du matériau brut
- 2- Préparation d'une pâte,
- **3- Moulage: couches d'épaisseur e= 20 μm- 100 μm**
- 4- Dépôt des électrodes métalliques et laminage
- **5- Pressage et compactage pour augmenter la densité de la céramique et éliminer l'air piégé entre les couches**
- 6- Chauffage à 750 °C pour éliminer le liant
- 7- Frittage à O<1100 °C
- 8- Câblage puis polarisation (E ~ qq MV/m)



**Procédés de fabrication** 



#### Actionneurs piézoélectriques haute tension

- 1- Mélange et broyage du matériau brut
- **2- Chauffage à T** $\cong$ **0.75 T**<sub>frittage</sub> pour augmenter la vitesse de réaction v ~ exp (-DH/RT) et broyage
- **3- Deuxième broyage et mélange de la poudre calcinée pour augmenter la réactivité**
- 4- Mise en forme et pressage de la céramique verte
- 5- Chauffage à 750 °C pour éliminer le liant
- 6- Frittage à Θ=1250 °C -1350 °C
- 7-Découpe, polissage, et nettoyage pour avoir la forme et les dimensions souhaitées
- 8- Dépôt des électrodes métalliques par sputtering (Platine ou palladium)
- 9- Polarisation (E ~qq MV/m) dans un bain d'huile





#### **Définitions fondamentales**



- Céramiques piézoélectriques PZT: anisotropes effet piézoélectrique dépend de la direction
- Principales directions : X, Y, Z=1, 2, 3  $\theta_X$ ,  $\theta_Y$ ,  $\theta_Z$  =4, 5, 6
  - → Axe 3: direction de polarisation
- dij [m/V]: Taux de déformation (m/m) par unité de champ électrique [V/m]
- i: direction du champ (Excitation), j: direction du déplacement (Réponse)
- gij [Vm/N]: coefficients de tension. Rapport du champ électrique de court-circuit [V/m] à la contrainte mécanique appliquée [N/m<sup>2</sup>]
- kij [adimensionnel]: Coefficients de couplage : rapports traduisant la conversion d'énergie mécanique électrique.
   Les coefficients dépendent de la température, la pression, le champ électrique, la forme, les conditions aux limites mécaniques et électriques.



#### **Propriétés fonctionnelles 1**





## **Propriétés fonctionnelles 2**



→Une charge a pour effet de déplacer la plage de fonctionnement

➔ Déplacement nominal inchangé

→Couplage à une masse via une rigidité non négligeable

=>Diminution du déplacement nominal

17/10/2006





**M.FOUAIDY** 



cement ép

#### Gamme des <sup>104</sup> actionneurs CEDRAT

 Grands déplacements par unite de longueur
 Haute densité d'énergie mécanique par unité de volume ou de masse
 Grande rigidité et densité de force
 Basse tension, faible 50

consommation Temps de réponse très court
10

17/10/2006



- PPA: Parallel Pre-stressed Actuators (PPAs) DPA (Direct Piezo Actuators)
- APA : Amplified Piezo Actuators (APAs)
- DPA, PPA et APA 🔶 Déplacements proportionnels à la tension appliquée
- DPA et PPA génèrent des Force très importantes (~qq kN)
- APA : génèrent à la fois des grands déplacements par unité de longueur (~100 μm/cm ou 1%) et des force très importantes
- Ultrasonic Piezo Actuators (UPÂs) similaires aux APA mais fréquence de résonance ultrasonique et grandes vitesses de vibration (m/s) à faible tension (10V AC). Générateurs ultrasonores.

• Linear Piezo Motors (LPMs) moteurs ultrasonores basse tension → Micropositionnement avec grands déplacements (>100 mm) et haute stabilité à une position donnée.

#### Caractéristiques électromécaniques d'actionneurs piézoélectriques



Fournisseur	EPCOS	NOLIAC	Piezo	Physical	Piezosystem
Paramètre (unité)			Mechanik	Instruments	JENA
Nom	PZT- Nd34	PZT pz27	PZT 5H	<b>PZT 25</b>	PZT
Longueur (mm)	30	30	55	35	42
Section (mm <sup>2</sup> )	7x7	10x10	7.5x7.5	10x10	5x5
Module de Young (GPa)	51	45	55	37	50
Déplacement nominal à T~300K (µm)	40	42	60	35	40
Fréquence (kHz)	?	66	14	40	?
Rigidité (N/µm)	83	150	56	105	25
Force bloquée (kN)	3.2	6.3	4	3.6	1
Capacité @300 K (µF)	2.1	5.7	11	12.4	3.4
Tension max. (V)	160	200	150	120	150



17/10/2006 M.FOUAIDY

#### Applications des actionneurs piézoélectriques





Fig. 1: A flexure-guided nanopositioning stage equipped with capacitive position sensors.

**M.FOUAIDY** 



Fig. 2: Run-out of a flexure-guided nanopositioning system with and without active trajectory control.

Ecole IN2P3 "Nouveaux matériaux"

Large gamme de géométrie, caractéristiques et performances

vision Accélérateurs

Déplacements microniques Résolution nanométrique

- Mécanique de précision
- → Déformation de structures
- → Micro-pompes
- Positionnement d'outils
- → Usinage de précision
- →Compensation d'usure
- →Actionnement de vanne aiguille
- →Servomécanismes de machines rapides
- Contrôle des couteaux des outils d'extrusion
- Amortissement actif des vibrations
- → Génération d'ondes de choc

#### High Load Z-Tip/Tilt Wafer Stage

- Z-stroke: 1.3 mm
- Tip/Tilt: +/- 4mrad
- Max. Load >50 kg
- Closed loop with internal incremental sensor



#### N-215.00

- Stroke: 20 mm
- Continuous Analog Mode: Resolution < 0.05 nm Range: to 4 μm
- Step Mode: Step size: 5nm - 8µm
- Blocking force: >500N
- Slipping force: >600N



# Stockage de données Test de disque Amortissement actif des vibrations Amortissement Semi-conducteurs et microélectronique Nano&Microlithographie Nano-métrologie Positionnement de masques et wafer Contrôle de dimensions critiques

•Optique, Photonique, Nano-métrologie

- → Miroirs
- → Auto focus
- Interférométrie
   Optique Adaptative et active
- Accord de Laser
- → Stimulation de vibrations

 Alignement et multiplexage de fibres optiques
 Stabilisation d'image, multipléxade de pixels

analog mode: PZT voltage: square wave, 5Hz, 3V<sub>pp</sub>



time /s

M.FOUAID



**De hautes** 

performances

**Des systèmes** 

multi-axes



 Sciences de la vie et médecine
 Microscopes électroniques à balayage
 Micro-pompes, microdistributeurs
 Micromanipulation et Manipulation de gènes, cellules



**M.FOUAIDY** 



- Caractérisation complète à basse température
- Résumé des tests des différents types d'actionneurs piézoélectriques (JENA, PICMA et NOLIAC)
- Irradiations aux neutrons rapides à basse température
- Effet de la précontrainte sur le comportement aux
- températures cryogéniques
- Dispositif expérimental

17/10/2006

- ➔ Effet d'une précontrainte axiale
- Réponse transitoire à un échelon de précontrainte
- Status du programme expérimental à l'IPN Orsay
  Tests du SAFR de Saclay dans CRYHOLAB
  Conclusions et perspectives



**M.FOUAIDY** 

## **Dispositif Experimental**



- •<u>CARATERISTIQUES</u> •Temperature : 1.8 K 300 K
- Etalonnage: Déplacement versus tension
  Propriétés diélectriques: Cp, Rp, Z, φ, tg(δ)
  Echauffement dû aux pertes diélectriques
  Popriétés thermiques: résistance, chaleur specifique
- Popriétés dynamiques



Actionneurs

17/10/2006 **M.FOUAIDY** 

#### **Résultats sur les actionneurs JENA 1**



#### **Résultats sur les actionneurs JENA 2**





Ecole IN2P3 "Nouveaux matériaux"

17/10/2006

**M.FOUAIDY** 

#### Actionneurs PICMA



Actionneurs muni d'une chaufferette, d'un thermomètre étalonné et jauge de contrainte

On observe clairement une hystérésis sur la caractéristique de l'actionneur à T=300 K. Cette hystéresis est negligeable à la température de l'helium liquide.

17/10/2006

Dimensions: 10 X 10 X 36 mm<sup>3</sup> **Déplacement Max.: 38 μm @ 120V** (10%) Capacité électrique: 12.4 μF Force bloquée : 3600 N @ 120V Rigidité : 105 N/μm Fréquence de Resonance: 40 kHz



#### Résulat d'étalonage d'un actionneur PICMA à T=300 K



**M.FOUAIDY** 

#### Test LHe à T=2.005 K- Actionneur PICMA #1





**M.FOUAIDY** 

17/10/2006

#### Dissipation dans les actionneurs piézoélectriques





-IPN

**M.FOUAIDY** 

17/10/2006

#### **Echauffements dus aux pertes diélectriques**





#### **Comparaison des actionneurs PICMA et NOLIAC**



 Déplacement maximum à 1.8 K > 3µm Les deux actionneurs adaptés pour les cavités ILC: compensation dynamique d'un décalage ~1kHz à E<sub>acc</sub>=33MV/m
 Pas de claquage ni d' endommagement observés pendant les tests
 → Durée de vie
 Forte corrélation entre la capacité Cp et

3) Forte correlation entre la capacité Cp et le déplacement maximum  $\Delta X$  (Cp $\propto \Delta X$  pour T<50 K)

Un moyen simple pour l'étalonnage d'un grand nombre d'actionneurs!

#### IRRADIATIONS AUX NEUTRONS RAPIDES A BASSE TEMPERATURE





- →Station d' irradiation aux neutrons au Cycotron du CERI (Orléans)
- ●Faisceau de Deutons (<u>Energie ≤ 25 MeV, Courant jusqu'à 35µA</u>)
- → Collision avec cible béryllium d'épaisseur 3 mm et refroidie (eau)
- → Production d'un haut flux de neutrons flux avec une faible dose  $\gamma$  (<20%)
- → Spectre en énergie des neutrons
  1-20 MeV
- → Dose totale  $\sim 10^{15}$  n/cm<sup>2</sup> (10 ans fonctionnement LHC) obtenue en  $\sim 20$  heures d'exposition
- Dimensions du cryostat (Diamètre: 270 mm, Hauteur: 600 mm)
- → Peut fonctionner en <u>Hélium liquide ou Argon liquide</u>

→Distance minimum entre source de neutrons et les composants irradiés : 80 mm



# Dispositif d'irradiations à basse température



#### **Tests d'irradiation terminés: 11 actionneurs testés, bonne tenue**



**M.FOUAIDY** 

17/10/2006

# Mesure de la fluence des neutrons



→ Méth réaction 58Ni (1 → L'ac haute p spectron → Déte ORTEC	ode d'active d'échange $1,p) \rightarrow 58$ tivité des poureté foils nétrie $\gamma$ du é cteur Ge-Li	ation basé de charg Co (1) pastilles d est déte 58Co à 810 refroidi à l'	ficial de ar ide			
Principa				ales caractéristiques du détecteur Ge-Li		
		Pastil nic	les de kel	Diamètre du cristal	<b>43 mm</b>	
-	1		Longueur du cristal	<b>51.5 mm</b>		
Quatre actionneurs PICMA prêts pour les tests Caracteristiques des pastilles de nickel			Tension	+ <b>4800</b> V		
			Résolution (a) 1.33 MeV(FWHM)	1.77 keV		
			Efficacité relative	11.4%		
<b>4</b>	0.125	14.4	Pur.(%) 99.999	Résolution @ 122 keV	<b>1.08 eV</b>	
•						



17/10/2006 M.FOUAIDY



17/10/2006 M.FOUAIDY

#### **Effect of fast neutrons on actuators properties at T=4.2K**

Capacité, résistance et angle de pertes versus dose totale. Actionneurs PICMA (P, ronds) and NOLIAC (N, triangles)







# **Objectifs de l'expérience précontrainte**

- → Effet d'une précontrainte variable sur les caractéristiques électromécaniques (ΔX,Cp, Rp, tgδ, Z, θ).
- Procédure pour appliquer, régler et contrôler cette précontrainte
- Etude de l'actionneur comme capteur de force
- ➔ Détermination de la rigidité mécanique de l'actionneur à basse température.



17/10/2006

## Principe de l'expérience précontrainte





#### Etude du bras de levier





Acier étiré de section 45x45  $\Delta X_c/\Delta X_p$ =17.7: proche de l'Objectif

## **Capacité versus précontrainte à T=4.4 K: test de** répétabilité





**M.FOUAIDY** 

Capacité versus précontrainte à T=2.05 K: précontrainte croissante et décroissante



 $Cp(F0) = 2.888 \ \mu f(a) \ 2.05K$ 

**Comportement linéaire** pour F<1400 N (Non intrinsèque!)

Forte hystérésis due à des irréversibilités (effet piézoélectrique, friction, jeu,....)

17/10/2006



Sensibilité pour F croissant :  $\Delta Cp/\Delta F=16 nF/kN$ Sensibilité pour F décroissant :  $\Delta Cp/DF=10nF/kN$ 



**M.FOUAIDY** 

#### Capacité versus précontrainte pour T=2.05 K- 83 K (précontrainte croissante)





17/10/2006

**M.FOUAIDY** 

#### Sensibilité à la précontrainte versus la température



Dépendance exponentielle:  $\Delta Cp/\Delta F$  augmente avec T de 16 nF/kN @ T=2 K à 426 nF/kN @ T=300 K



17/10/2006

**M.FOUAIDY** 

# Réponse transitoire à un échelon de précontrainte



PN 17/10/2006

M.FOUAIDY

## Amplitude du signal transitoire pour différentes précontraintes à T=4.2K

teurs





# **PREMIER TEST SAF DANS CRYHOLAB**





Intégration des actionneurs dans SAF: étude conceptuelle 📗

Division Accélérateurs

Basé sur le concept d'actionneur piézoélectrique amplifié
 Faible déplacement (<3.5 µm @2 K)→ Amplification</li>
 Support des actionneurs: en titane avec système de bras de leviers → amplification du

déplacement

Support placé entre l'enceinte hélium et le SAF : il remplacera les barres de compression du SAF initial.





Simulation par éléments finis: déplacement amplifié par un facteur 3 suivant la direction longitudinale de la cavité